

# Microscopie électronique

## Scanning Electron Microscopy

### → Equipement

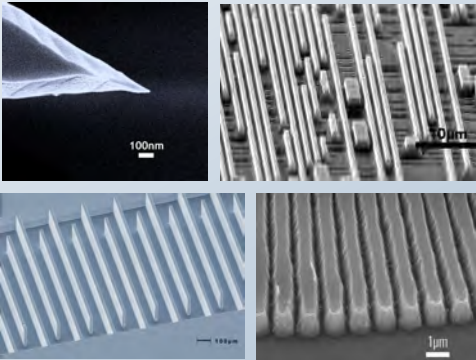


JEOL JSM 6460

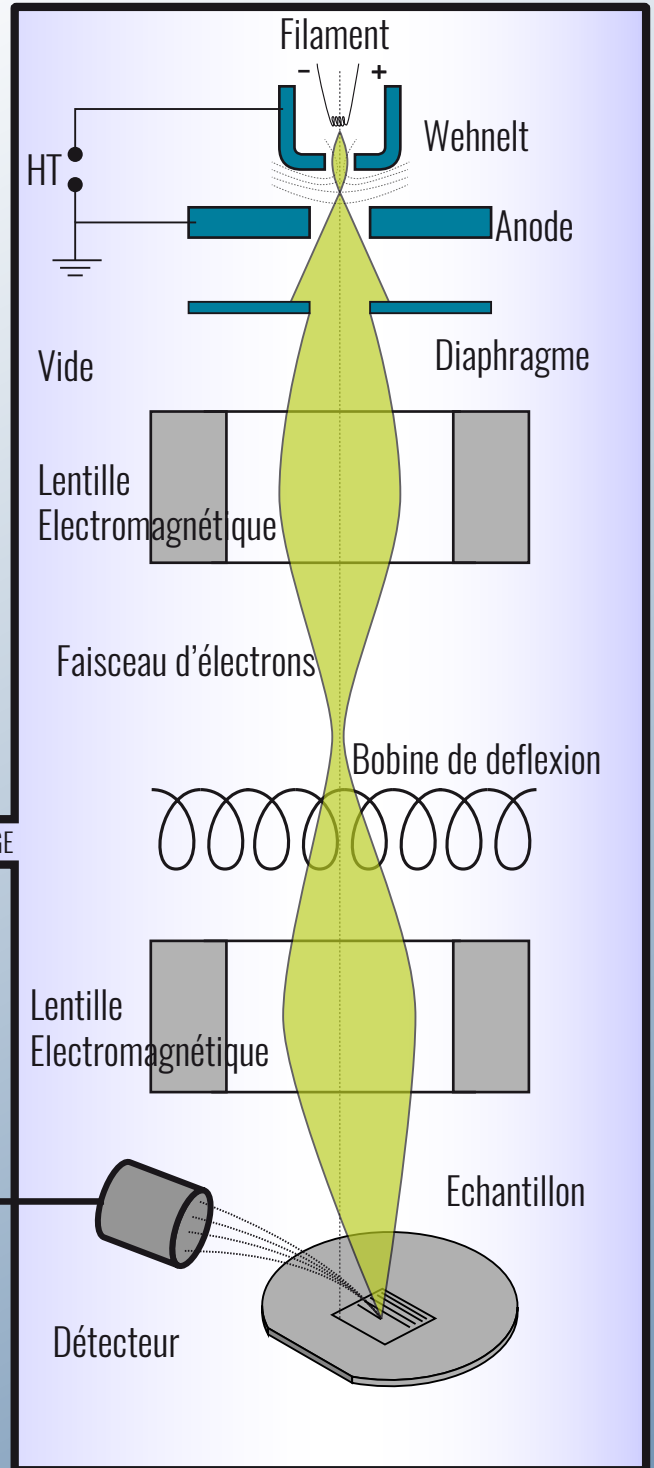
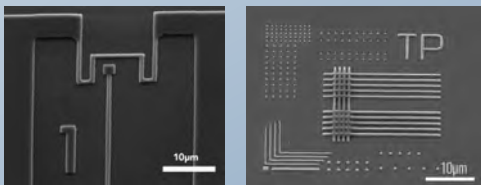


FEI Inspect S50

### → Analyse et métrologie



### → Lithographie électronique Système Raith sur Jeol JSM6460



VUE EN COUPE D'UNE COLONNE DE MEB



Centrale de Technologie  
en Micro et nanoélectronique

